小型 PECVD 管式炉系统炉说明书

OTF-1200X-50-PE-S

天津品创科技发展有限公司

产品简介

OTF-1200X-50-PE-S 是一款小型的 PE-CVD（等离子体气相沉积）管式炉系统。此套设备带有 500W 的等离子射频电源，一个炉管直径为 50mm 的开启式管式炉（带有真空法兰和连接管道）和一个直联式双旋机械泵。因此这套设备模型可以更新为不同的 PECVD 系统。对于有限的经费的情况下来进行材料探索，此套系统极为理想。

主要特点

1、与普通 CVD 相比可以在低温环境下进行气相沉积实验

2、对于薄膜的应力可以通过射频电源的频率来进行控制

3、通过工艺调节来控制化学计量

4、能够广泛地用于各种材料沉积，如 SiOx, SiNx, SiOxNy 和无定型硅(a-Si:H) 等

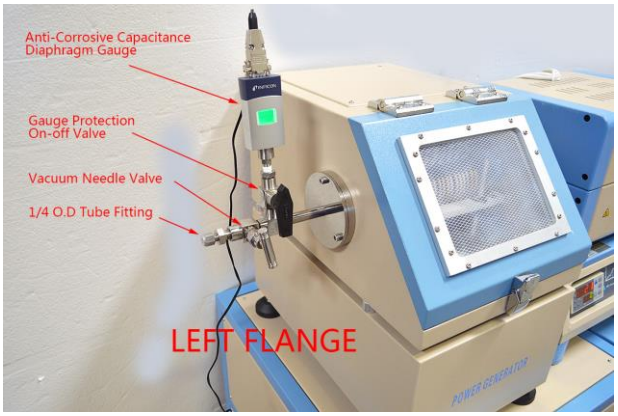
真空法兰和接头

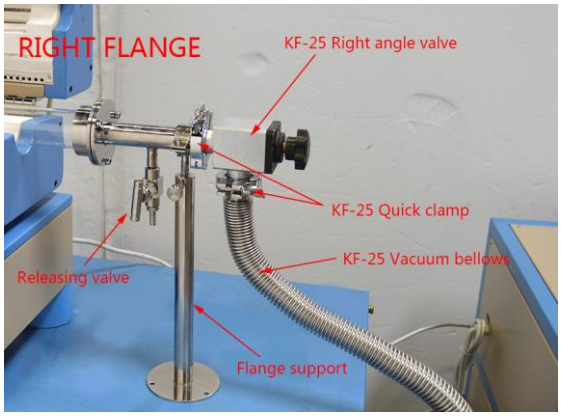
1、真空法兰采用 304 不锈钢制作

2、左端法兰上安装有防腐型数字真空计、不锈钢针阀和一个球阀。

3、右端法兰设计为 KF25 接口，上面配有泄气阀，挡板阀和两个 KF25 卡箍

5、仪器中所配的数字真空计，可以不用因使用气体的不同而进行校正，同时还具有防腐功能





技术参数

产品型号	OTF-1200X-50-PE-S
电源	208 - 240V AC
最大功率	1.2KW
工作温度	最高工作温度 1200℃（小于 1 小时）
	连续使用温度 1100℃
炉膛	采用高纯氧化铝作为炉膛材料，并且表面涂有美国进口高温氧化铝涂层，可延长仪器使用寿命和提高加热效率
炉管	高纯石英炉管
	炉管尺寸：50mmOD x 44mmID x 780mmL
加热区	可设置 30 段升降温程序，并带有过热和断偶保护
	每个温区长度为 200mm
	恒温区长度为 60mm(+/-1° C)
真空泵	AC 220V 50 Hz 1/2HP 375W
	2L/s
	与本公司管式炉配套使用，可使其真空度达到 10-2 torr2L/s
	进气端带有储气球（防止回油），出气端安装有油雾过滤器（防止油雾扩散到空气中，保护环境和人体健康）
等离子体射频电源	输出功率： 5 -500W 可调
	稳定性为+/-1%
	射频电源频 13.56 MHZ, 稳定性±0.005%
	最大反向功率： 200W max
	射频电源电子输出口： 50 Ω， N 型半岛体， 阴极
	噪声<50 dB
	冷却方式：空气冷却
	输入电源： 208-240VAC, 50/60Hz
可选配置	防腐型小型三路浮子混气系统
	精密气液混合系统
	三路质子混气系统
外形尺寸	1500mm x 600mm x 1200mm(L x W x H)
重量	160 lbs
质保期	整机一年保修（相关耗材除外，如炉管、密封圈、加热原件）

品创科技
TIANJIN17.COM

电话 ：022-87938642

传真 ：022-87938643